

真空または不活性雰囲気下での高温熱処理を行うための一体型真空炉です。
セラミックファイバー断熱材を使用した真空炉は、真空ろう付け、焼結、
アニールなどの熱処理プロセスにおいて、経済的かつ効率的な選択肢となります。
炉体は二重構造の水冷式チャンバーで構成されており、循環水冷却装置との併用が可能です。



【特徴】

① 炉体構造

- ・ 水冷式二重円筒構造を採用し、炉壁温度は55℃以下に維持。
- ・ 加熱部・電極・真空ポートを中央部に配置。
- ・ 外装に吸気口・導入・排気バルブを装備。

② 加熱・断熱系

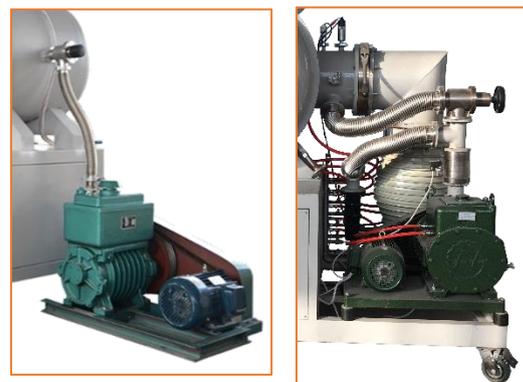
- ・ 炉内はセラミックファイバー断熱材。
- ・ 加熱素子は温度条件に応じてSiCロッドまたはMoSi₂ロッド。
- ・ 均一加熱を実現し、加熱体の修理・交換も容易。
- ・ 電極部は真空用シール構造で気密性・絶縁性を確保。

③ 真空系

- ・ 真空度に応じてロータリーポンプまたは拡散ポンプと併用。
- ・ 金属ベローズにより炉体への振動伝達を抑制。
- ・ 複合型デジタル真空計を使用し、測定範囲は大気圧～10⁻⁵Pa。

④ 制御系

- ・ 10インチタッチパネル、プログラムコントローラーなどを搭載。
- ・ 温度制御精度±1℃、最大16プログラム×30ステップ保存可能で、PID自動調整機能付き。
- ・ 熱電対はS型またはB型を使用し、制御盤に炉内温度をデジタル表示。
- ・ 電源制御、記録、モニタリング、警報機能付き。



(左) ロータリーポンプ、
(右) ロータリーポンプと拡散ポンプ併用



炉外観



二重構造の水冷式チャンバー



温度制御タッチパネル、
複合型デジタル真空計

※ 実際の製品は図と異なる場合がございます。

【仕様】

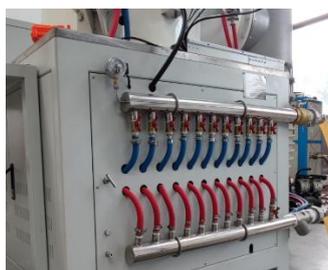
型番	OSK 33LK-VC14	OSK 33LK-VC17
最高温度(℃)	1400℃	1700℃
最大使用温度	1300℃	1600℃
加熱素子	SiCヒーター	MoSi ₂ ヒーター
熱電対	Sタイプ	Bタイプ
炉内材質	高純度セラミックファイバー	
昇温速度	0~20℃/分	
温度制御精度	±1℃	
到達真空度	冷間時 10Pa または 6.7×10 ⁻³ Pa	
温度制御精度	±1℃	
温度制御方式	PID自動制御（SCR電力制御方式）、 最大16種類の加熱曲線、各曲線に最大30セグメント設定可能	
電源	三相 AC 200V、50/60Hz	
炉内サイズ(W×D×H)mm	150×150×200	200×200×300 300×300×400 400×400×500

【標準構成】

- ・ OSK 33LK-VCシリーズ 1400-1700℃ セラミックファイバー真空チャンバー炉 一式
- ・ 高温用断熱手袋（1双）
- ・ 坩堝用 tong（1本）
- ・ 保証期間：1年間（※発熱体および消耗部品は保証対象外）
- ・ 取扱説明書

【オプション】

- ・ 循環水冷却システム



冷却水配管



チラー

※ 炉の仕様によって、チラーの型式や冷却水配管の本数が異なる場合がございます。

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2025/7/7